

仙台国際フォーラム2009

「第5回フラウンホーファーシンポジウム in SENDAI」

The 5th Fraunhofer-Gesellschaft Symposium in Sendai ～From MEMS to Smart Systems Integration～

開催概要:自動車産業や半導体産業など様々な産業に活用が期待される「MEMS技術」を中心としたマイクロ・ナノテクノロジー分野の将来性やコアプロセスに関する先端技術・技術革新について、国内外の研究開発を推進するトップランナーからご講演いただきます。
また、今回はマッチングセッション(ポスターセッション)を設け、参加者の皆様と講演を行う研究者等とのマッチングを図るとともに、ラボツアーセッションを設け、フラウンホーファーの最先端研究所のバーチャルラボツアー及び仙台地域のラボツアーを実施いたします。

日時:平成21年11月24日(火)10:00~17:50・25日(水)9:30~17:30
会場:ホテルメトロポリタン仙台4階「千代」仙台市青葉区中央1丁目1-1 TEL:022-268-2521
Hotel Metropolitan Sendai [Room Sendai] (アクセス <http://www.s-metro.stbl.co.jp/access/index.html>)
主催:東北大学, 仙台市, フラウンホーファー研究機構(FhG), フラウンホーファー日本代表部
Tohoku University, City of Sendai, Fraunhofer-Gesellschaft, Fraunhofer Representative Office Japan
後援:経済産業省 METI, MEMSパークコンソーシアム MEMS park consortium

講演題目および講演者 Program (日・英同時通訳“Simultaneous interpretation”)

11/24 「第5回フラウンホーファーシンポジウム in SENDAI」

10:00~10:05	Welcome Address Emiko Okuyama, Mayor, City of Sendai	「開会挨拶」 仙台市長 奥山 恵美子
I. Keynote Session		
10:05~10:20	The Latest Technologies and Applications - Applied Research of Fraunhofer Gesellschaft Dr. Lorenz Granrath, Fraunhofer Representative Office Japan	「フラウンホーファー研究機構の応用研究:最新技術・アプリケーション」 フラウンホーファー日本代表部代表 ローレンツ・グランラート
10:20~11:05	The Trend and the Future of MEMS Prof. Masayoshi Esashi, Tohoku University	「MEMSの動向と未来」 東北大学 教授 江利 正喜
11:05~11:50	Focus of Fraunhofer ENAS: Smart System Integration Prof. Dr. Thomas Gebner, Director of Fraunhofer ENAS	「フラウンホーファーENASの研究フォーカス:スマートシステム・インテグレーション」 フラウンホーファーENAS 所長 トーマス・ゲブナー
11:50~13:00	Lunch Break	昼 食 休 憩
II. Technology Session		
13:00~13:40	Advanced Process Stabilization Technology for Automated Deposition of Reactively Sputtered Precision Thin Films Dr. Koichi Suzuki, Fraunhofer FEP Representative Japan	「反応性スパッタ高精密膜の自動成膜のための先進プロセス安定化技術」 フラウンホーファーFEP 日本代表 鈴木 巧一
13:40~14:20	New Packaging and Interconnect Technologies for Ultra Thin Chips Mr. Rolf Aschenbrenner, Fraunhofer IZM Director of the Dept. System Integration & Interconnection Technology	「超薄チップ用パッケージング・相互接続の新技術」 フラウンホーファーIZM システムインテグレーション・ インターコネクション技術部門部長 ロルフ・アッシュェンブレナー
14:20~15:00	Ultrafine Nano Processes*Damage-free Neutral Particle Etching Technology* Prof. Seiji Samukawa, Tohoku University	「超微細ナノプロセス『超低損傷・中性粒子ビームエッチング技術』」 東北大学 教授 寒川 誠二
15:00~15:30	The Stealth Dicing Technology for MEMS Mr. Naoki Uchiyama, Hamamatsu Photonics K.K.	「MEMS向けステルスダイシング技術の最新動向」 株式会社浜松ホトニクス 内山 直己
III. Virtual Lab Tour Session		
15:40~16:05	Research Infrastructure at Fraunhofer ENAS Mr. Jörg Frömel, Fraunhofer ENAS	「フラウンホーファーENASの研究インフラ」 フラウンホーファーENAS ヨルク・フレイメル
16:05~16:30	Research Infrastructure at Jun-ichi Nishizawa Research Center Assistant Prof. Yu-Ching Lin, Tohoku University	「東北大学西澤潤一記念研究センターの研究インフラ」 東北大学 助教 林 育青
IV. Matching Session (Poster Session)		
16:30~17:45	Fraunhofer ENAS, FEP, IZM Tohoku University, Esashi-Lab, Samukawa-Lab Research Institute of Technology in TOHOKU Advanced Industrial Science and Technology TOHOKU Center	フラウンホーファーENAS, FEP, IZM 東北大学江刺研究室, 寒川研究室 東北6県の公設試験場 産業技術総合研究所東北センター
17:45~17:50	Closing Address Prof. Masayoshi Esashi	「閉会挨拶」 東北大学 教授 江利 正喜
18:00~19:30	Reception	懇親会 (参加費:無料)

11/25 「第5回フラウンホーファーシンポジウム in SENDAI ラボツアーセッション」(希望者のみ)

9:30		仙台駅前 集合
10:00~11:30	Jun-ichi Nishizawa Research Center in TOHOKU Univ.	東北大学西澤潤一記念研究センター 視察
11:30~13:00	Lunch Break	昼食休憩 (会場をご案内いたします。各自昼食をお取りください)
13:30~15:00	Advantest Component, Inc.	株式会社アドバンテストコンポーネント 視察
15:30~17:00	MEMS ShowRoom / Stealth Dicing Lab (in MEMS CORE Co., Ltd.)	MEMSショールーム/ステルス・ダイシングラボ 視察 (メムス・コア内)
~17:30		仙台駅前 解散